

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕРМ - 2001

ТЕР--2001

Часть 32. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СРЕДСТВ СВЯЗИ

Номера расценок	Наименование	Индексы				
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	оплата труда машинистов	материалы
1	2	3	4	5	6	7
ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ						
Раздел 1. ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
Таблица м32-01-001-1. Таблица 32-01-001 Агрегаты откачные вакуумные						
м32-01-001-1	Агрегат откачной вакуумный	10,82	12,23	5,60	12,23	5,32
Таблица м32-01-002. Таблица 32-01-002 Вакуумное напылительное оборудование						
м32-01-002-1	Установка вакуумного напыления	10,29	12,23	5,61	12,23	7,00
м32-01-002-2	Система автоматизированного осаждения слоев кремния при пониженном давлении	10,13	12,23	5,69	12,23	6,53
Таблица м32-01-003-1. Таблица 32-01-003 Вакуумные насосы						
м32-01-003-1	Насос механический вакуумный	9,90	12,23	5,71	12,23	4,19
Раздел 2. ТЕРМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
Таблица м32-01-020-1. Таблица 32-01-020 Печи с контролируемой средой						
м32-01-020-1	Печь электрическая сопротивления конвейерная водородная	10,38	12,23	5,30	12,23	5,97
Таблица 32-01-021 Оборудование для эпитаксии						
Таблица м32-01-021. Установка:						
м32-01-021-1	Установка: выращивания эпитаксиальных структур гидридным методом при пониженном давлении, СВЧ обогревом	10,53	12,23	5,80	12,23	6,98
м32-01-021-2	Установка: эпитаксиального наращивания пленок монокристаллов	10,46	12,23	5,58	12,23	7,92
м32-01-021-3	Установка: наращивания эпитаксиальных слоев	9,92	12,23	5,62	12,23	7,70
м32-01-021-4	Установка: для изготовления многослойных гетероэпитаксиальных структур	10,23	12,23	5,70	12,23	6,18
Таблица 32-01-022 Оборудование для впавления и диффузии						
Таблица м32-01-022. Установка ионно-лучевая, масса:						
м32-01-022-1	Установка ионно-лучевая, масса: 3,2 т	10,43	12,23	5,58	12,23	5,82
м32-01-022-2	Установка ионно-лучевая, масса: 4,0 т	10,48	12,23	5,59	12,23	6,35
м32-01-022-3	Установка ионно-лучевая, масса: 5,5 т	10,46	12,23	5,68	12,23	6,55
м32-01-022-4	Система диффузионная однозонная многотрунная	10,13	12,23	5,61	12,23	6,86
Таблица 32-01-023 Прочее термическое оборудование						
Таблица м32-01-023. Установка:						
м32-01-023-1	Установка: спекания микроканальных блоков с размерами сечения до 70x90 мм	10,16	12,23	5,65	12,23	5,31
м32-01-023-2	Установка: выращивания кристаллов	9,49	12,23	5,78	12,23	6,47
Раздел 3. СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
Таблица 32-01-035 Оборудование для сварки электронным лучом						
Таблица м32-01-035. Установка для:						
м32-01-035-1	Установка для: лазерной сварки и термообработки металлов	10,11	12,23	5,88	12,23	5,91
м32-01-035-2	Установка для: обработки металлов непрерывным излучением твердотельного лазера	10,80	12,23	5,76	12,23	5,82
Таблица м32-01-036-1. Таблица 32-01-036 Оборудование для микросварки						
м32-01-036-1	Установка ультразвуковой сварки	11,00	12,23	5,53	12,23	4,97
Таблица м32-01-037-1. Таблица 32-01-037 Прочее оборудование для сварки						
м32-01-037-1	Машина заварки ЭОС компланарного типа в баллоны ЦЭЛТ	10,03	12,23	5,66	12,23	5,93
Таблица м32-01-037. Установка приварки маски к раме ЦЭЛТ, масса:						
м32-01-037-2	Установка приварки маски к раме ЦЭЛТ, масса: 0,69 т	10,57	12,23	5,69	12,23	5,84
м32-01-037-3	Установка приварки маски к раме ЦЭЛТ, масса: 1,13 т	10,17	12,23	5,73	12,23	5,73
м32-01-037-4	Установка приварки маски к раме ЦЭЛТ, масса: 1,34 т	10,08	12,23	5,76	12,23	5,75
Таблица м32-01-037. Установка сварки пружин с рамой ЦЭЛТ, масса:						
м32-01-037-5	Установка сварки пружин с рамой ЦЭЛТ, масса: 0,68 т	10,49	12,23	5,69	12,23	7,02

м32-01-037-6	Установка сварки пружин с рамой ЦЭЛТ, масса: 1,08 т	10,14	12,23	5,75	12,23	6,15
Таблица м32-01-037. Установка приварки держателей к раме ЦЭЛТ, масса:						
м32-01-037-7	Установка приварки держателей к раме ЦЭЛТ, масса: 0,945 т	10,45	12,23	5,72	12,23	6,76
м32-01-037-8	Установка приварки держателей к раме ЦЭЛТ, масса: 1,025 т	10,26	12,23	5,73	12,23	6,18
м32-01-037-9	Установка приварки накладок к раме собранной ЦЭЛТ-42	11,33	12,23	5,72	12,23	6,34
м32-01-037-10	Установка сварки заготовки световодов	10,86	12,23	5,62	12,23	5,40
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ						
Таблица м32-01-050. Таблица 32-01-050 Оборудование для обработки металлических деталей и кремниевых пластин						
м32-01-050-1	Полуавтомат для резки полупроводниковых пластин	11,00	12,23	5,54	12,23	5,06
м32-01-050-2	Агрегат автоматизированный резки слитков на пластины	10,73	12,23	5,64	12,23	5,93
Таблица 32-01-051 Шлифовальное и доводочное оборудование						
Таблица м32-01-051. Станок:						
м32-01-051-1	Станок: доводочный однодисковый	10,57	12,23	5,53	12,23	5,08
м32-01-051-2	Станок: для ручной шлифовки	11,00	12,23	5,53	12,23	4,95
м32-01-051-3	Станок: шлифовальный доводочный	10,40	12,23	5,56	12,23	5,00
м32-01-051-4	Станок: грубой шлифовки стекол фотошаблонов	9,71	12,23	6,00	12,23	6,15
Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ СТЕКОЛЬНОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА						
Таблица 32-01-061 Мельницы						
Таблица м32-01-061. Мельница шаровая, масса:						
м32-01-061-1	Мельница шаровая, масса: 1 т	9,04	12,23	5,89	12,23	4,20
м32-01-061-2	Мельница шаровая, масса: 4,2 т	9,07	12,23	5,91	12,23	5,10
Таблица м32-01-062-1. Таблица 32-01-062 Сита						
м32-01-062-1	Сито вибрационное	9,91	12,23	5,68	12,23	3,90
Таблица м32-01-063-1. Таблица 32-01-063 Транспортные и загрузочные устройства						
м32-01-063-1	Конвейер сборки горизонтально-замкнутый	9,41	12,23	5,83	12,23	5,13
Таблица 32-01-064 Прочее оборудование для обработки изделий из стекла						
Таблица м32-01-064. Установка для изготовления:						
м32-01-064-1	Установка для изготовления: заготовок световодов	10,69	12,23	5,80	12,23	5,59
м32-01-064-2	Установка для изготовления: стеклянных штабиков, автоматическая	9,96	12,23	5,87	12,23	5,80
м32-01-064-3	Станок штрипсовый	10,40	12,23	5,72	12,23	5,04
м32-01-064-4	Установка для вытягивания световодного волокна	10,82	12,23	5,73	12,23	6,10
м32-01-064-5	Полуавтомат алмазно-отрезной	10,30	12,23	5,56	12,23	4,83
Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ						
Таблица м32-01-070. Таблица 32-01-070 Оборудование для нанесения специальных покрытий						
м32-01-070-1	Автомат эмалирования чашечного вывода анода ЦЭЛТ	9,76	12,23	5,78	12,23	4,71
м32-01-070-2	Установка для нанесения шликера на конусы ЦЭЛТ	11,10	12,23	5,51	12,23	5,11
Таблица 32-01-071 Оборудование для химической обработки поверхности						
Таблица м32-01-071. Установка химического травления:						
м32-01-071-1	Установка химического травления: многожильных жестких световодов	10,04	12,23	5,80	12,23	6,54
м32-01-071-2	Установка химического травления: заготовок микроканальных пластин автоматическая	10,81	12,23	5,77	12,23	6,83
м32-01-071-3	Установка химической очистки заготовок микроканальных пластин, автоматическая	11,08	12,23	5,56	12,23	7,28
м32-01-071-4	Автомат плазмохимического удаления фоторезиста	11,24	12,23	5,78	12,23	6,61
Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ СБОРОЧНОЕ						
Таблица м32-01-080-1. Таблица 32-01-080 Оборудование для сборки ЦЭЛТ						
м32-01-080-1	Станок бандажирования цветных кинескопов	11,02	12,23	5,51	12,23	4,97
Раздел 8. ОБОРУДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ И ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ						
Таблица м32-01-086. Таблица 32-01-086 Оборудование для фотопроцессов						
м32-01-086-1	Установка совмещения и мультипликации	10,31	12,23	5,63	12,23	5,04
м32-01-086-2	Генератор изображения	9,88	12,23	5,79	12,23	5,02
Таблица м32-01-086. Оже-спектрометр электронный, масса:						
м32-01-086-3	Оже-спектрометр электронный, масса: 0,2 т	10,34	12,23	5,48	12,23	4,06
м32-01-086-4	Оже-спектрометр электронный, масса: 1,624 т	10,72	12,23	5,89	12,23	6,25
м32-01-086-5	Спектрометр рентгеновский трехканальный	10,91	12,23	5,58	12,23	5,17
м32-01-086-6	Установка совмещения экспонирования	10,18	12,23	5,55	12,23	5,20
Раздел 9. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ						
Таблица 32-01-092 Оборудование для очистки воды						
Таблица м32-01-092. Установка для:						
м32-01-092-1	Установка для: очистки воды, автоматизированная	9,96	12,23	5,89	12,23	5,01

м32-01-092-2	Установка для: умягчения воды	10,02	12,23	5,78	12,23	5,35
Раздел 10. ИСПЫТАТЕЛЬНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
Таблица 32-01-098 Оборудование для климатических испытаний						
Таблица м32-01-098. Термокамера, масса:						
м32-01-098-1	Термокамера, масса: 1,6 т	9,95	12,23	5,80	12,23	4,98
м32-01-098-2	Термокамера, масса: 2,2 т	10,08	12,23	5,77	12,23	5,18
Таблица м32-01-098. Камера тепла, масса:						
м32-01-098-3	Камера тепла, масса: 0,19 т	10,95	12,23	5,71	12,23	4,84
м32-01-098-4	Камера тепла, масса: 0,76 т	10,56	12,23	5,72	12,23	5,09
м32-01-098-5	Камера тепла, влаги и грибообразования	10,60	12,23	5,81	12,23	5,61
м32-01-098-6	Камера холода, тепла и влаги	10,00	12,23	5,72	12,23	6,63
м32-01-098-7	Стенд электротренировки	10,63	12,23	5,79	12,23	5,37
м32-01-098-8	Камера микроклиматическая	10,49	12,23	5,67	12,23	5,23
Таблица м32-01-099. Таблица 32-01-099 Оборудование для механических испытаний						
м32-01-099-1	Установка вибрационная механическая	10,25	12,23	5,75	12,23	5,15
м32-01-099-2	Установка вибрационная	10,08	12,23	5,72	12,23	4,14
Таблица м32-01-099. Установка вибрационная электродинамическая, масса:						
м32-01-099-3	Установка вибрационная электродинамическая, масса: 2,1 т	10,16	12,23	5,80	12,23	5,79
м32-01-099-4	Установка вибрационная электродинамическая, масса: 4,875 т	9,92	12,23	5,59	12,23	7,94
м32-01-099-5	Установка ударная	10,94	12,23	5,75	12,23	5,22
м32-01-099-6	Установка для испытаний на воздействие линейных ускорений	8,14	12,23	6,46	12,23	4,69
м32-01-099-7	Стенд для испытания на воздействие линейных нагрузок	10,72	12,23	5,71	12,23	5,41
Таблица м32-01-100-1. Таблица 32-01-100 Измерительное оборудование						
м32-01-100-1	Установка измерения электрических параметров ЦЭЛТ-32	10,62	12,23	5,79	12,23	5,18
Таблица м32-01-101. Таблица 32-01-101 Оборудование для контроля						
м32-01-101-1	Установка визуального контроля качества проявления и качества поверхности полупроводниковых пластин	11,07	12,23	5,69	12,23	4,69
м32-01-101-2	Машина для определения глубины залегания Р-П перехода	10,94	12,23	5,54	12,23	5,04
м32-01-101-3	Установка функционального контроля	10,87	12,23	5,53	12,23	4,78
м32-01-101-4	Установка двухпозиционная для визуального контроля масок	11,03	12,23	5,53	12,23	5,00
м32-01-101-5	Установка контроля сферы маски	10,88	12,23	5,58	12,23	5,43
м32-01-101-6	Система параметрического функционального контроля полупроводниковых ЗУ и БИС микропроцессоров	10,47	12,23	5,84	12,23	5,31
м32-01-101-7	Установка контроля прозрачности сферизованных масок ЦЭЛТ	11,00	12,23	5,62	12,23	4,79
м32-01-101-8	Система контроля микроканальных пластин по структурным параметрам лазерная с управлением от ЭВМ	10,17	12,23	5,83	12,23	4,82
Таблица м32-01-101. Установка контроля параметров:						
м32-01-101-9	Установка контроля параметров: микроканальных пластин	10,98	12,23	5,80	12,23	5,99
м32-01-101-10	Установка контроля параметров: катодолуминофоров	10,20	12,23	5,77	12,23	5,04
ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СРЕДСТВ СВЯЗИ						
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ						
Таблица 32-02-001 Оборудование для резки, скрутки, закатки, зачистки и обжига						
Таблица м32-02-001. Автомат для:						
м32-02-001-1	Автомат для: изготовления перемычек	12,12	12,23	5,74	12,23	11,90
м32-02-001-2	Автомат для: подготовки проводов	8,89	12,23	5,90	12,23	11,62
м32-02-001-3	Автомат для: подготовки монтажных проводов	11,70	12,23	5,73	12,23	11,24
Таблица м32-02-001. Полуавтомат:						
м32-02-001-4	Полуавтомат: комплексной обработки ленточных проводов	11,86	12,23	5,70	12,23	11,05
м32-02-001-5	Полуавтомат: подготовки к монтажу ленточных проводов типа ПВП	11,92	12,23	5,70	12,23	11,66
м32-02-001-6	Автомат мерной резки ленточных проводов	12,13	12,23	5,78	12,23	11,97
Таблица м32-02-002-1. Таблица 32-02-002 Оборудование для намотки проводов						
м32-02-002-1	Станок намоточный	12,13	12,23	5,91	12,23	12,10
Таблица м32-02-002. Станок рядовой намотки, масса:						
м32-02-002-2	Станок рядовой намотки, масса: 0,07 т	12,12	12,23	5,78	12,23	11,62
м32-02-002-3	Станок рядовой намотки, масса: 0,13 т	12,04	12,23	5,65	12,23	11,64
Таблица м32-02-003. Таблица 32-02-003 Оборудование для пропитки и сушки моточных изделий						
м32-02-003-1	Смеситель для приготовления эпоксидных компаундов	8,92	12,23	5,85	12,23	4,62
м32-02-003-2	Установка для пропитки	8,69	12,23	5,89	12,23	4,58
м32-02-003-3	Установка для заливки радиоизделий в вакууме	8,71	12,23	5,88	12,23	4,26
Таблица м32-02-004-1. Таблица 32-02-004 Оборудование для пайки и лужения печатных плат и радиоэлементов						
м32-02-004-1	Автомат пайки интегральных схем на МПП	11,48	12,23	6,33	12,23	11,30

Таблица м32-02-004. Установка:						
м32-02-004-2	Установка: пайки малогабаритная	11,76	12,23	5,67	12,23	9,90
м32-02-004-3	Установка: пайки	11,78	12,23	5,64	12,23	9,42
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ						
Таблица м32-02-010. Таблица 32-02-010 Оборудование для механической обработки печатных плат						
м32-02-010-1	Ножницы гильотинные	9,78	12,23	5,49	12,23	3,85
м32-02-010-2	Установка раскроя листового материала	8,58	12,23	5,67	12,23	3,94
м32-02-010-3	Установка для сверления и штифтовки пакетов печатных плат	11,37	12,23	6,31	12,23	11,51
м32-02-010-4	Станок полуавтоматический с нижним шпинделем	11,57	12,23	5,54	12,23	11,35
м32-02-010-5	Модуль гибкий производственный ГПМ для сверления	8,19	12,23	5,97	12,23	9,83
м32-02-010-6	Станок фрезерный 2-х шпиндельный с ЧПУ	9,01	12,23	5,90	12,23	10,12
м32-02-010-7	Линия механизированной зачистки	11,69	12,23	5,71	12,23	9,76
м32-02-010-8	Линия гидроабразивной обработки	10,93	12,23	6,36	12,23	9,53
м32-02-010-9	Установка гидроабразивной зачистки	9,13	12,23	5,70	12,23	10,54
м32-02-010-10	Линия автоматическая изготовления заготовок	9,84	12,23	5,53	12,23	10,64
Таблица м32-02-011-1. Таблица 32-02-011 Оборудование для нанесения и получения рисунка схемы на местах						
м32-02-011-1	Установка для нанесения фоторезиста	12,07	12,23	5,74	12,23	10,44
Таблица м32-02-011. Установка экспонирования, масса:						
м32-02-011-2	Установка экспонирования, масса: 0,46 т	11,72	12,23	5,72	12,23	10,31
м32-02-011-3	Установка экспонирования, масса: 0,65 т	11,69	12,23	5,67	12,23	10,48
м32-02-011-4	Установка экспонирования сетчатых трафаретов	11,66	12,23	5,72	12,23	10,40
м32-02-011-5	Установка проявления трафаретных форм	11,79	12,23	5,68	12,23	10,21
м32-02-011-6	Линия проявления СПФ	10,13	12,23	5,70	12,23	9,75
м32-02-011-7	Установка проявления СПФ	9,37	12,23	5,88	12,23	5,20
м32-02-011-8	Установка ультрафиолетового отверждения	6,71	12,23	5,93	12,23	3,65
м32-02-011-9	Установка для снятия фоторезиста	8,64	12,23	5,74	12,23	9,95
м32-02-011-10	Линия снятия фоторезиста	9,08	12,23	5,91	12,23	5,24
м32-02-011-11	Установка снятия СПФ	8,69	12,23	5,89	12,23	4,61
Таблица м32-02-012. Таблица 32-02-012 Оборудование для изготовления многослойных печатных плат						
м32-02-012-1	Комплекс оборудования для травления и снятия краски	9,35	12,23	5,92	12,23	5,23
м32-02-012-2	Линия механической подготовки поверхности заготовок	8,92	12,23	5,90	12,23	9,97
м32-02-012-3	Линия конвейерная ультразвуковая промывки ПП	8,61	12,23	5,75	12,23	9,10
м32-02-012-4	Линия отмывки печатных плат деионизированной водой	8,83	12,23	6,05	12,23	5,12
м32-02-012-5	Линия химической подготовки	8,83	12,23	5,90	12,23	4,38
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАГНИТОПРОВОДОВ И ВОЛНОВОДОВ						
Таблица м32-02-018. Таблица 32-02-018 Оборудование для изготовления магнитопроводов						
м32-02-018-1	Установка для навивки магнитопроводов из лент железоникелевых сплавов	11,62	12,23	5,71	12,23	10,04
м32-02-018-2	Полуавтомат для навивки ленточных сердечников	11,97	12,23	5,66	12,23	10,49
м32-02-018-3	Станок намотки сердечников тороидальных трансформаторов	11,94	12,23	5,78	12,23	10,63
м32-02-018-4	Установка электрофрезная с электродинамическим натяжением ленты	11,21	12,23	6,27	12,23	10,85
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОРТИРОВКИ, КОНТРОЛЯ, СБОРКИ, ТРЕНИРОВКИ, МЕХАНИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ						
Таблица м32-02-024-1. Таблица 32-02-024 Оборудование для разбраковки и проверки						
м32-02-024-1	Пост автоматический контроля транзисторов и радиоэлементов	12,04	12,23	5,64	12,23	11,89
Таблица м32-02-024. Установка испытательная:						
м32-02-024-2	Установка испытательная: пробойная	12,12	12,23	5,78	12,23	11,54
м32-02-024-3	Установка испытательная: высоковольтная	12,11	12,23	5,91	12,23	11,47
Таблица м32-02-025. Таблица 32-02-025 Оборудование для установки и сборки радиоэлементов						
м32-02-025-1	Автомат подготовки радиоэлементов	12,01	12,23	5,65	12,23	11,45
м32-02-025-2	Полуавтомат обработки выводов радиоэлементов	11,95	12,23	5,65	12,23	11,44
м32-02-025-3	Полуавтомат установки радиоэлементов	11,04	12,23	6,29	12,23	11,02
Таблица м32-02-025. Автомат:						
м32-02-025-4	Автомат: установки радиоэлементов с осевыми выводами	9,20	12,23	5,91	12,23	10,65
м32-02-025-5	Автомат: вклеивания в ленту радиоэлементов	11,36	12,23	6,31	12,23	11,03
м32-02-025-6	Автомат: установки микросхем на печатные платы	10,71	12,23	6,11	12,23	10,89
м32-02-025-7	Автомат: установки транзисторов	11,06	12,23	6,28	12,23	11,43
м32-02-025-8	Автомат: сборки и пайки микросхем	11,12	12,23	6,28	12,23	10,74
Таблица м32-02-026. Таблица 32-02-026 Оборудование контрольно-испытательное и тренировочное						
м32-02-026-1	Стенд вибрационный механический	11,35	12,23	5,33	12,23	4,85
м32-02-026-2	Установка вибрационная электродинамическая	8,06	12,23	5,91	12,23	4,19
м32-02-026-3	Установка ударная	11,08	12,23	6,24	12,23	5,12
м32-02-026-4	Копер ударный	8,39	12,23	5,90	12,23	4,28
м32-02-026-5	Центрифуга, стенд центробежных перегрузок	8,53	12,23	5,91	12,23	4,67
м32-02-026-6	Стенд имитации транспортирования	8,52	12,23	5,81	12,23	4,11
м32-02-026-7	Камера тепла и холода	8,74	12,23	5,70	12,23	10,18
м32-02-026-8	Камера тепла и влаги	11,09	12,23	6,26	12,23	10,59
м32-02-026-9	Термобарокамера	8,74	12,23	5,70	12,23	10,18
Таблица м32-02-027. Таблица 32-02-027 Оборудование для контроля печатных плат и электрических параметров телевизоров и радиоприемников						
м32-02-027-1	Стенд для контроля кабелей и плат	11,52	12,23	6,30	12,23	11,81

Часть 32. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СРЕДСТВ СВЯЗИ

м32-02-027-2	Контрольно-испытательная телевизионная установка	11,22	12,23	6,12	12,23	10,08
--------------	--	-------	-------	------	-------	-------